RECEIVED CENTRAL FAX CENTER

NOV 1 2 2004

PAT-NO:

JP404100533A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04100533 A

TITLE:

VACUUM CONTAINER

PUBN-DATE:

April 2, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MARUYAMA, TAKAHIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP02217609

APPL-DATE:

August 18, 1990

INT-CL (IPC): B01J003/03, C09K003/10, C22C019/03

US-CL-CURRENT: 118/733

ABSTRACT:

PURPOSE: To repeatedly use one seal material by forming the seal material interposed between a lid body and a vacuum container main body from a shape memory alloy and providing a heater heating the seal material to the transition temp. thereof or higher to restore the same to its original shape.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer is inserted in a treatment chamber 1a from a taking in and out port 2 in such a state that a door 3 is opened and, thereafter, the door 3 is closed. A seal material 11 composed of a shape

memory alloy is preheated before the door 3 is closed to be set to an initial state. when the door 3 is closed to clamp the seal material to a main body 1 by a clamping member, the seal material 3 is deformed so as to collapse between the door 3 and the main body 1. By this method, high airtightness like a usual. metal seal can be obtained. After the completion of etching treatment, the door 3 is opened and the semiconductor wafer is taken out. When the door 3 is opened, the seal material 11 is in a deformed state at about room temp. but, by heating the door 3 to 70° C or higher by the heater 13 built in the door 3, the seal material 11 is restored to its original shape before deformation.

COPYRIGHT: (C) 1992, JFO&Japio

P.21

⑩ 日本国特許庁(JP)

即特許出顧公開

平4-100533 母公開特許公報(A)

Int. Cl. 5

建別記号

庁内整理番号

四公開 平成4年(1992)4月2日

B 01'J C 09 K 19/03

2102-4C Q 9159-4H 8928-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

真空容器 日発明の名称

> 顧 平2-217609 图符

平2(1990)8月18日

②発 明者

兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

三麥電機株式会社 か 頭 人

東京都千代田区丸の内 2丁目 2番3号

砂代 理 人 岩大 士野代 増雄 外2名

」、発明の名称

英空容器

2. 特許請求の範囲

被処理物の出し入れ口を開閉する董仲を擴えた 真空容額において、前記蓋体と真空容器本体との 間に介益されるシール材を形状記憶合金によって 形成すると共に、このシール材を転移温度以上に 加熱して復元させるヒータを設けたことを特徴と する真空容忍。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は被処理物の出し入れ口を開研する其件 を借えた真空容器に関し、特に単体用シール材の 構造に関するものである。

(世来の技術)

従来のこの様の真空容器としては、例えば半導 体記憶袋斌を型造する際に使用するエッチングテ 1回によって以明する。

~ 第3図は従来のエッチングチャンパーの反略様 成长示す断爾國である。同國において、しはエッ チングチャンパーの本体で、この本体!は内部に 処理室1aが設けられ、一側部にはこの処理室1 ●に対して半導体ウエハ(図示せず)を出し入れ するための出し入れ口?が閉口されている。

3 は前記出し入れ口 2 を閉研するための資件と しての命で、この罪3は本体1に接起自在に支持 されている。4は前記即3と本体1との期のほ間 から気体が濃微するのを防ぐためのシール材で、 このシール材もとしては、ふっ素系ゴムによって 形成されたロリングが使用されている。そして、 このシール材4は前記算3に保持されており、罪 3 をポルト (図示せず) 等の縁結部材によって木 体】に固定して出し入れ口2を塞いだ時に、本体 1の側筒に圧換されるように構成されている。

5 は本体 1 内の気体を排出するための非気装置 で、排気管6を介して本体1の処理型しょに適遇 ナンパーがある。このエッチングチャンパーを第 されている。なお、Tは俳気管 5 を開閉するため のベルプである.

特朗平4-100533(2)

このように構成された従来のエッチングチャンパーでは、頭目を聞いて半導体ウェハを本体1の処理窓1 m内に挿入し、頭目を閉じて投気装置5によって処理窓1 m内を被圧させる。この状態でエッチングガスが供給される。エッチング終了後は、換気装置5によってエッチング必要の終了した中ではカェハを本体1外へ取り出す。

(発明が解決しようとする課題)

しかるに、このように構成された従来のエッチ ッグチャンパーでは、帰るのシール材 4 としてゴ より、ようなが、このようながない。また、このようながない。また、このようながよった。また、コーングを使用すると、エッチ 4 自体が数 変性の高いがであった。リークや発展の上ではない。気間性、耐寒食性の高いシールはないによる。 変別のメタルシールからと無いために繰り返してはったができない。

おいて前記第3回で説明したものと四一もひくは 同等節はについては、同一符号を付し詳細な説明 は省略する。これらの図において、11は本体1 と肺3との間の気密を保持するためのシール材で、 このシール材ししは形状記憶合金からなり、断面 略円形の円扉状に形成されている。そして、この シャル材ししは、尿るにおける本体しと対向する 部分に形成された理状の団体12内に監査されて 保持されており、乗3を本体Ⅰに固定して出し入 れ口2を閉塞した時に、本体1の側面に圧慢され るようにpi皮されている。このシール材11を形 **旭する形状記憶合金としては、例えばテタンとニ** ッケルの合金が採用されており、ある転移温度以 下で変形させても経移為度以上に加熱すれば元の ※状に反すことができる。この伝移満度は、チタ ソーニッケル合金の場合、その混合比を変えるこ とによって、~180m~100m程度まで開発 することができる。本実施例では転移温度が70 でになるように合金の賃合比を調整したものを使っ 用した.

(異題を解決するための手段)

本発明に任る真空容器は、董林と真空容器本体 との間に介望されるシール材を形状配信合金によって形成すると共に、このシール材を伝移電圧以 上に加熱して復元させるヒータを設けたものであ 1

(作 用)

董林を真空容易本体に締め付けることにより形 状紀像合金型シール材が変形して気宙が保持され、、 董体を聞いた時にヒーダで前記シール材を加熱す ることによって、シール材は変形間の形状に復元 する。

(实施例)

以下、本発明の一実施例を第1図(a) ~(d) によって詳値に以明する。

第1回(a) ~(d) は本発明に係る真空容異の程 時構成を示す節間図で、同図(a) は脈を閉める前 の初期状態、同図(b) は縁を閉めた状態、同図(c) は処理後に膝を閉けた状態、両図(d) はヒーター により加熱を行なった状態を示す。これらの図に

1 1 は前記シール材 1 1 を転移過度以上に加熱するためのヒーターで、このヒーター1 3 は戻るに内配されている。

次に、このように体収された其空容器の動作に ついて説明する。先ず、鮮了を開けた状態で出し 入れ口でから半年体ウエハを処理器しる内に挿入 し、雌3を閉じる。シール材11は、雌3を閉じ る前に予め加熱して第1図(m) に示すように初算 状態にしておく。肌3を閉じて締結部材によって 本作1に終付けると、シール対11は第1回(b) に示すように、乗ると本体」との間で潰れるよう に更形する。これによって、通常のメタルシール のように高い気密性を得ることができる。半導体 ウェハのエッチング処理終了後、舞るを開いて半 導体ウェハを本体(外へ取り出す。第3を関ける と、変単程度ではシール材11は第1回(c) に示 すように変形したままであるが、豚3に内取され たヒーター13により印3の温度を70で以上に 上げることによって、シール材 1 1 は第 1 図(d) に示すように元の変形的の形状に復元する。

5098383424

したがって、本発明に係る真空容器では、エッチングガスの悪影響を受けることの少ないシール 材11を出り返し使用することができ、しかも最 3を反復して関閉しても、その他皮質い気を快か 得られる。

チング装置に応用した場合、世来のゴム製のシール材を用いた時のようなエッチングガスによる影 酒や腐食がなくなる関係から、耐久性に優れかつ 発度の少ないエッチング装置を得ることができる。 4. 図面の簡単な説明

せる力を小さく済ますことができ、シールの信奴

性を高めることができる。

第1個(a) ~(d) は本発明に係る其空容器の機能構成を示す断面図で、開図(a) は風を開める前の初期状態、問図(b) は風を開めた状態、同図(c) は処理後に扉を開けた状態、同図(d) はヒーターにより加熱を行なった状態を示す。第2回は断面 C 字状を呈する円環状に形成されたシール材の他の実施例を示す新規図、第3図は世界のエッチングチャンバーの医時構成を示す新国図である。

1 ····本件、2 ····罪、1 l ····シール材、1 3 ····ヒーター、

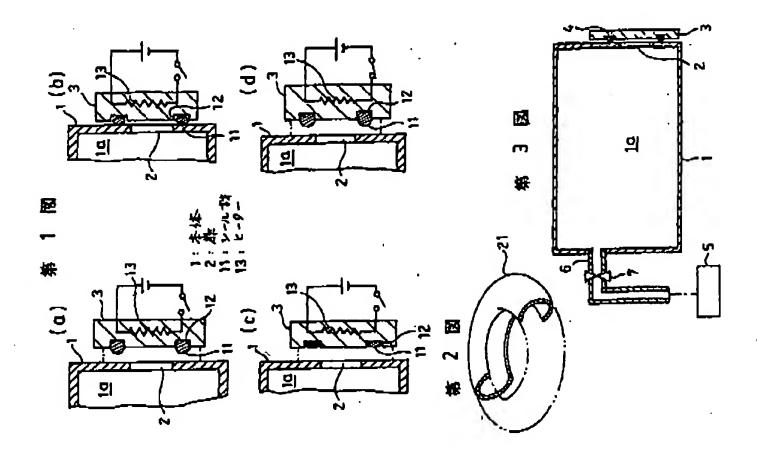
化理人 大岩堆堆

せた、本実施例では真空容器としてエッチング チャンパーを例示したが、本発明はこのような限 定にとらわれることなく、関節する無を有する実 空容器であれば、どのような容器であっても適用 することができる。

(桑切の効果)

P.24

特別平 4-100533 (4)



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.